

大見研究室 和文 論文リスト

1985年

- 1(M) 大見忠弘、「制御された低エネルギー粒子プロセスは次世代のVLSIに不可欠」、日経マイクロデバイス特別編集版、(日経マグロウヒル社)、pp.94-95、1985年2月。
- 2(M) 大見忠弘「LSI基盤技術の整備と周辺産業の役割」、エスロンタイムズ、1985年5月。
- 3(M) 大見忠弘、「よりソフトでクリーンなプロセス実現を」、日経産業新聞、(日本経済新聞社)、1985年5月27日。
- 4(M) 大見忠弘、菅野洋一、「半導体用ガス配管系の高性能化」、半導体ガスの配管技術講習会テキスト、(衛生技術会)、pp.2-1~2-41、1985年6月。
- 5(M) 大見忠弘、「微細化極限を指向するLSIデバイスとプロセス」、電通談話会記録、電気通信の研究、創立50周年特別号、(東北大学電気通信研究所)、pp.62-63、1985年9月。
- 6(P) 大見忠弘、「イオンを用いた加工技術」、「85 イオン工学特別シンポジウムテキスト、(イオン工学懇談会)、1985年11月。